

開示の要約

基板処理装置

- 5 測定工程の最適化を実現することができる基板処理装置が開示される。基板処理装置は、ハウジングの正面側外壁に隣接して、複数のロードポートを横並びに配置するロード・アンロード部と、正面側外壁に接続された、ハウジングの側面側外壁に隣接して、鉛直方向に並んで配置された、基板の表面状態を測定するための上段測定モジュールおよび下段測定モジュールと、を備える。

10

図 4